

**РЕКОМБИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В РАДИАЦИОННО ОБЛУЧЕННЫХ
ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУРАХ
НА ОСНОВЕ СЕЛЕНИДА ГАЛЛИЯ**

Абасова А. З., Заитов Ф. А., Любченко А. В.,
Султанмурадов С.

Исследовано влияние нейтронного и γ -облучения на фотоэлектрические характеристики фоточувствительных структур на основе слоистых монокристаллов p -GaSe. Обсуждаются схема энергетических уровней (рекомбинации, свечения и прилипания), механизмы термического гашения и активации фототока в базовой области структур. Радиационное фотоочувствление при малых дозах связано с преимущественным образованием пар дефектов по подрешетке Ga и Se — центров фоточувствительности и прилипания (глубокие компенсированные доноры и мелкие акцепторы соответственно).

Влияние радиационного облучения на электрофизические и люминесцентные свойства слоистых кристаллов GaSe p -типа изучалось в работах [1–3]. Установлено, что при γ -облучении возникают акцепторные уровни $E_a = -0.1 \div -0.2$ эВ, возрастает фоточувствительность (малые дозы), происходит перераспределение интенсивностей W полос примесной люминесценции — тушение полос $h\nu_m = 1.72$ и 2.03 эВ, разгорание 1.36 и 1.2 эВ (77 К) [2, 3], при больших дозах ($2.6 \cdot 10^4$ Кл/кг) квантовый выход всех полос свечения резко падает. К последнему эффекту приводят и нейтронное облучение. Показано, что в спектральной чувствительности фотодиодных структур наряду с собственным максимумом фотопроводимости ($\Phi\Pi$) при $\lambda_m = 0.6$ мкм имеется область УФ чувствительности с $\lambda_m = 0.4$ мкм [4]. В диодах с S -характеристикой длинноволновая граница $\Phi\Π$ доходит до 1.1 мкм при 300 К.

В настоящей работе изучалось влияние различных видов радиационного облучения на спектральные и температурные характеристики $\Phi\Π$ фоточувствительных структур на базе p -GaSe в интервале $80 \div 350$ К. Структуры получены вплавлением олова (выпрямляющий контакт) на монокристаллическую пластину p -GaSe с удельным темновым сопротивлением $10^2 \div 10^4$ Ом·см и подвижностью дырок $30 \text{ см}^2/\text{В}\cdot\text{с}$ при 300 К [4]. Структуры подвергались облучению γ -квантами от источника ^{60}Co [дозы $(2.6 \div 2.6) \cdot 10^4$ Кл/кг] и быстрыми нейтронами с энергией более 0.1 МэВ ($10^{12} \div 10^{14} \text{ см}^{-2}$).

В исходных структурах при собственном возбуждении ($\lambda_m = 0.6$ мкм) температурная зависимость имеет сложный характер (рис. 1). В области высоких температур ($270 \div 300$ К) падение $I_\Phi(T)$ связано с развитием процесса температурного гашения фототока (ТГФ). В области низких температур идет процесс его температурной активации (ТАФ). Наблюдение этих эффектов связано с реализацией в базовой области структур сложной (многоцентровой) рекомбинационной модели,ключающей s -канал интенсивной рекомбинации, r -центры фоточувствительности, t -центры прилипания основных ННЗ [5]. В области ТАФ ($150 \div 200$ К) регистрируются пики термостимулированной проводимости, связанные с неравновесным заполнением компенсированных мелких акцепторов t -уровней прилипания с глубиной залегания в диапазоне $E_{st} = -0.1 \div -0.2$ эВ.

Влияние радиационного облучения на величину $\Phi\Π$ при низких температурах неоднозначно. Например, для нейтронного облучения в области радиа-

ционного ощущения величина I_ϕ при 80 К может возрастать либо уменьшаться с ростом дозы облучения в связи с изменением наклонов кривых ТАФ (рис. 1).

Типичной для S-структур является более резкая ТАФ примесного фототока ($0.7 < \lambda < 1$ мкм) (рис. 2, а). Такая активация реализуется и в том случае, если температурная зависимость собственной ФП выражена слабо. После нормировки на зависимость $I_\phi(T)$ для $\lambda_m=0.60$ мкм «индивидуальная» энергия ТАФ для примесной ФП дает величину $E_i=0.05 \div 0.07$ эВ (для различных структур), близкую к половине E_{av} (рис. 2, б).

Максимальная ФП для собственного возбуждения при использованных скоростях объемной генерации пар L (в $\text{см}^{-3} \cdot \text{с}^{-1}$) в случае монополярной p -фотопроводимости ($\Delta p \gg \Delta n$) реализуется между областями ТГФ и ТАФ [5]. Максимальное время жизни основных ННЗ в такой схеме

$$\tau_p = g_r / C_{pr} (\Delta p + N_r^0), \quad (1)$$

где $g_r \sim C_{nr} (\mathcal{N}_r - N_r^0)$, реализуется между областями ТГФ и ТАФ и зависит от выхода рекомбинационного потока на r -канал ($g_r \ll 1$), пропорционального коэффициенту захвата электронов (C_{nr}) и концентрации дырок на r -уровнях ($\mathcal{N}_r - N_r^0$); коэффициента захвата дырки C_{pr} и концентрации электронов N_r^0 , образующейся в результате оптической перезарядки между r - и глубокими t -уровнями ($N_r^0 \approx \mathcal{N}_t$). Высокая фоточувствительность и монополярность ФП в кристаллах p -GaSe [6] связаны с наличием достаточной для конкуренции с иными каналами (излучательной и безызлучательной) рекомбинации концентрации r -уровней \mathcal{N}_r — компенсированных доноров. Их компенсация осуществляется более мелкими акцепторами, в том числе t -типа, которые в актуальном интервале температур (300 К) практически не захватывают ННЗ.

Радиационное облучение, перестраивая точечно-дефектную структуру кристалла, может управлять концентрациями уровней различного типа. При этом увеличение \mathcal{N}_r и компенсирующих их акцепторов, уменьшение концентраций s - и глубоких t -уровней должны приводить к возрастанию τ_p (1), радиационному фотоочувствлению и «разгоранию» полосы люминесценции, связанной с излучательным захватом свободных дырок глубокими уровнями, в том числе r -типа [2].

При неизменной величине $\mathcal{N}_r (g_r)$ фотоочувствление в заданном интервале температур может быть осуществлено также радиационно-химическим преобразованием t -уровней — уменьшением их глубины залегания либо компенсацией более мелкими акцепторами, что исключает соответствующий член (N_r^0) в (1). Уменьшение глубины залегания акцепторных уровней при γ -облучении наблюдалось в [1].

С r -центрами естественно связать примесную полосу ФП, интенсивность которой пропорциональна величине τ_p (1) при условии $g_r=1$ и зависит от технологических режимов получения кристаллов GaSe и структур. Энергетическое положение r -уровня относительно v -зоны $E_{av}=1.25$ эВ совпадает с C -полосой свечения ($h\nu_m=1.23$ эВ), преобладающей в спектре люминесценции высокоменных кристаллов при 90 К [3]. Дополнительными свидетельствами этой

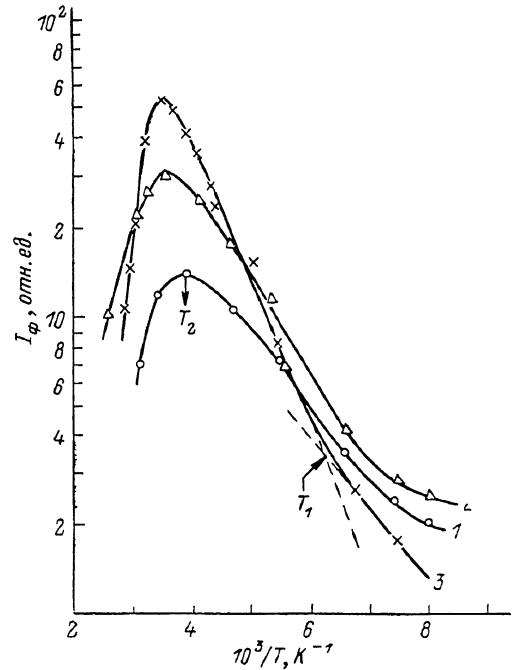


Рис. 1. Температурные зависимости фототока $I_\phi(T)$ исходных и облученных нейтронами структур.

$\Phi \cdot 10^{-18}, \text{ см}^{-2}$: 1 — исходный образец, 2 — 1, 3 — 4.3. $\lambda_m=0.61$ мкм, $U_{\text{cm}}^{\text{pp}}=10$ В.

связь могут служить совпадение областей тушения I_ϕ и W , идентичность дозовой зависимости при γ -облучении, так как обе величины пропорциональны выходу рекомбинационного потока $g_r \sim N_r$. Определение $E_{cr} = E_g - E_{vr}$ по наклонам кривых в области ТГФ затруднено наложением эффекта ТАФ.

Трансформация формы кривых $I_\phi(T)$ нейтронно облученных структур в области термоактивации связана с изменением концентрации r - и t -уровней. Удвоение наклона кривых в координатах $\ln I_\phi - 1/T$ может реализоваться в случае близости величин N_r , N_t и предельной оптической перезарядки уровней при низких температурах [7] — их световой декомпенсации. Расчет показывает [5, 8], что в этих условиях с увеличением темпа термогенерации локали-

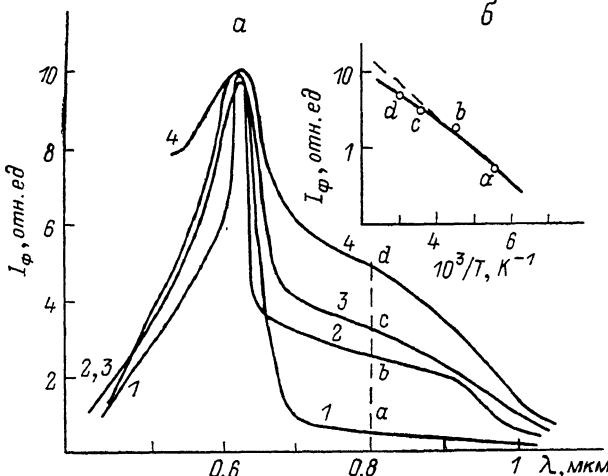


Рис. 2. Спектральное распределение фототока (а) при различных температурах и температурная зависимость примесного фототока (б).

а) T, K : 1 — 185, 2 — 235, 3 — 293, 4 — 330; б) $\lambda=0.8$ мкм (точки а—д).

зованных на t -уровнях дырок в c -зону концентрация ННЗ и g_r (1) в области ТАФ экспоненциально возрастают с наклонами:

$$g_r(T) \sim \exp\left(-\frac{E_{vt}}{2kT}\right), \quad \tau_p = \frac{p}{L} \sim \exp\left(-\frac{E_{vt}}{kT}\right). \quad (2)$$

Далее в ТАФ $g_r \ll 1$, и этот тип уровней практически не участвует в процессе рекомбинации, до точки перегиба (T_1) (рис. 1) активация I_ϕ проходит в условиях контроля величины τ_p и фоточувствительности более быстрыми типами рекомбинационных уровней. Дополнительное очущение при $T > T_1$ [удвоение наклона зависимости $I_\phi(T)$ до $0.1 \div 0.12$ эВ] связано с ростом g_r (2) и переходом рекомбинационного потока на r -уровни. Еще одним подтверждением эффекта предельной перезарядки r -уровней является наличие ТАФ при примесном возбуждении (рис. 2). В условиях их постоянного заполнения дырками ($N_r \ll N_t$), что реализуется при малой концентрации t -уровней ($N_t \ll N_r$), энергия ТАФ равна $E_i = E_{vt}/2$ [9]. Нормировка кривых на зависимость $I_\phi(T)$ при собственном возбуждении выделяет активационную часть, связанную с ростом коэффициента поглощения фотонов, пропорционального величине g_r (1). Соответствующие области ТАФ при собственном и примесном возбуждении совпадают.

Высокотемпературная точка (T_2) перегиба зависимости $I_\phi(T)$ (рис. 1) удовлетворяет условию равенства интенсивностей тепловых переходов c -зона — r -уровень (приводит к ТГФ) и t -уровень — v -зона. По соответствующей величине $N_{vt}(T_2)$ можно оценить нижний предел концентрации t -уровней [5], который в исследованных кристаллах возрастает с увеличением дозы нейтронного облучения и при $\Phi = 4.3 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-2}$ равен $N_t \approx 2.5 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$. Наблюдаемое в таких условиях радиационное фотоочущение при 300 К означает, что одно-

временно растет и концентрация донорных r -уровней [величина g_r , (1)]. До определенных доз увеличение взаимно компенсирующих пар ($\mathcal{N}_r \simeq \mathcal{N}_{s'}$) и величины g_r , преобладает в механизме дефектообразования. Превышение порога (зависящего от типа облучения) связано с преимущественным образованием дефектов, образующих быстрый s -канал рекомбинации. Последнее должно приводить к параллельному тушению фоточувствительности и квантового выхода наблюдаемых полос излучательной рекомбинации, что наблюдается в данном случае [^{2, 3}]. Роль s -канала рекомбинации могут выполнять протяженные дефекты (области сильного радиационного разупорядочения) как стоки для неравновесных носителей заряда в прилегающем объеме кристалла. Эффективность влияния таких областей на электрофизические и фотоэлектрические параметры снижается геттерированием дефектов в межслоевых промежутках (аналогично эффекту интеркалирования примесей), что приводит к большей радиационной устойчивости слоистых материалов (типа GaSe). В качестве фотоэлектрически активных центров в GaSe могут выступать собственные дефекты в подрешетке металлоида: вакансии селена (V_{Se}) как глубокие доноры при их компенсации являются центрами фоточувствительности, междоузельные атомы Se — центрами прилипания. В пользу этого предположения свидетельствуют следующие факты: более слабая химическая связь атомов Se, что связано со спецификой кристаллической структуры слоистых соединений, идентичность r -центров в специально не легированных и легированных кристаллах [⁸], симбатная зависимость концентрации пар дефектов (V_{Se} , Se _{r}) от дозы радиационного облучения. Как быстро мигрирующие дефекты [¹⁰] междоузельные атомы Se в основном сосредоточены в межслоевых промежутках.

Со временем диффузионное растекание сегрегированных радиационных атомов приводит к восстановлению (частичному либо полному) точечно-дефектной структуры материала и его электрофизических и фотоэлектрических характеристик.

Л и т е р а т у р а

- [1] Абдуллаев Г. Б., Абасова А. З., Аскеров К. А., Заитов Ф. А., Стafeев В. И., Салаев Э. Ю. // Изв. АН СССР. Неорг. матер. 1983. № 4. С. 679—681.
- [2] Абдуллаев Г. Б., Абасова А. З., Заитов Ф. А., Лепнев Л. С. // ФТП. 1982. Т. 16. В. 6. С. 1136—1137.
- [3] Абасова А. З., Заитов Ф. А., Рычкова О. В., Юнович А. Э. // ФТП. 1986. Т. 20. В. 4. С. 613—618.
- [4] Абдуллаев Г. Б., Залетаев Н. Б., Мамедова А. З., Рудовол Т. В., Стефеев В. И. // Радиотехн. и электрон. 1979. № 7. С. 1430—1432.
- [5] Лашкарев В. Е., Любченко А. В., Шейнкман М. К. Неравновесные процессы в фотопроводниках. Киев, 1981. 264 с.
- [6] Абдуллаев Г. Б., Любченко А. В., Алиева М. Х., Алиев Т. И. // Изв. АН АзССР. Сер. физ.-мат. 1972. № 2. С. 29—39.
- [7] Абдуллаев Г. Б., Алиева М. Х., Беленъкий Г. Л., Кролевец Н. М. и др. // УФЖ. 1971. Т. 15. В. 11. С. 1806—1811.
- [8] Рывкин С. М. Фотоэлектрические явления в полупроводниках. М., 1963. 494 с.
- [9] Гарягдыев Г., Городецкий И. Я., Любченко А. В., Нурягдыев О. // ФТП. 1986. Т. 20. В. 11. С. 1989—1993.
- [10] Вавилов В. С., Кив Е. А., Ниязова О. Р. Механизмы образования и миграции дефектов в полупроводниках. М., 1981. 368 с.

Получена 15.03.1988
Принята к печати 6.09.1988